

-1-

ACCESSION NUMBER
TITLE
PATENT APPLICANT
INVENTORS
PATENT NUMBER
APPLICATION DETAILS
SOURCE

84-138461
LIQUID JET RECORDING APPARATUS
(2000100) CANON INC
HARA, TOSHITAMI; YANO, YASUHIRO; HARUTA, MASAHIRO
84.08.08 J59138461, JP 59-138461
83.01.28 83JP-012444, 58-12444
84.12.07 SECT. M, SECTION NO. 343; VOL. 8, NO. 267,
PG. 34.

INT'L PATENT CLASS
JAPIO CLASS
FIXED KEYWORD CLASS
ABSTRACT

B41J-003/04
29.4 (PRECISION INSTRUMENTS--Business Machines)
R105 (INFORMATION PROCESSING--Ink Jet Printers)
PURPOSE: To record an image increased in the
faithfulness of the response to a recording signal
and high in resolving power and quality at a high
speed in a liquid jet recording apparatus, by
providing an opening separate from an emitting port
on a liquid flowline.
CONSTITUTION: An opening 119 separate from an orifice
108 is provided in order to prevent the
non-stabilization in the emission of a liquid from
the orifice caused by such a state that air bubbles
are stayed in the deep part (in the vicinity of a
front wall plate 103) of a liquid flowline 118 during
ink filling and achieves an auxiliary function for
venting a part of air present in the liquid flowline
during ink filling and not venting only from the
orifice 108. The liquid flowline between the orifice
108 and the opening 119 efficiently performs the
emission of the liquid from the orifice 108 and, in
order to prevent the emission of the liquid from the
opening 119 when heat energy is imparted to the
liquid from the heat acting surface 115, the shape of
a partition wall 117 may be determined so as to make
the liquid flowline narrow. One or more of the
opening 119 is usually provided to the deepest part
of the liquid flowline, that is, in close vicinity of
the front wall plate 103 and the diameter thereof is
pref. made smaller than that of the orifice 108.

12 公開特許公報 (A)

昭59—138461

SDInt. Cl.³
B 41 I 3/04

識別記号
103

片内整理番号
7810-2C

43公開 昭和59年(1984)8月8日

| | |
|------|-----|
| 発明の数 | 1 |
| 審査請求 | 未請求 |

(全 6 頁)

⑤液体噴射記録装置

特 願 昭58-12444

出 願 昭58(1983)1月28日

◎發明者原利民

東京都大田区下丸子3丁目30番
2号キヤノン株式会社内

の発明者 矢野泰弘

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号キヤノン株式会社内

發明者 春田昌宏

東京都大田区下丸子3丁目30番
2号キヤノン株式会社内

出 願 人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番
2号

代理人 弁理士 若林忠

4 2 3

1. 発明の名称

液体喷射试验器

2. 特殊請求の範囲

1. 熱エネルギーの利用によって媒体を吐出し果
 局的感度を形成するために設けられた複数の吐
 出口と、これ等の吐出口に直通し、前記果局的
 感度を形成するための媒体が供給される設室
 と、該設室に前記媒体を供給するための供給口
 と、前記吐出口のそれぞれに対応して設けられ
 た、前記熱エネルギーを発生する手段としての
 複数の電気熱変換体とを具備し、該電気熱変換
 体のそれぞれは、発生される熱エネルギーが前
 記媒体に作用する面としての熱作用面を前記設
 室の底面に有し、前記吐出口のそれぞれは、該
 底面に相い向かいあって設けられ、前記設室内
 に、それぞれ隣接する熱作用面間及び吐出口間
 を隔離する隔離壁が設けられ、それぞれの吐出
 口毎に前記媒体の感度面を有する媒体噴射制御
 装置に於いて、前記感度面上に吐出口とは別の

第 2 の開口が設けられてゐることを特徴とする液体噴射記録装置。

2. 前吐出口とそれに対応する前第2の開口との間の腔隙路が狭げられてなる特殊請求の装置第1項と彼の腔体吸引装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、吐出口より液体を吐出することによって形成された液滴の液滴を用いて記録を行う液体噴射記録装置、特に超音波エネルギーを利用する液体噴射記録装置に関する。

液体噴射記録装置には、種々の方式があるが、その中でも、例えば独逸公同特権(OLS)2944005号公報に開示された液体噴射記録装置は、高圧力ラー記録が容易であって、その出力部の主要部である記録ヘッドは、記録用の液体を吐出して、飛翔的液滴を形成するための吐出口（オリフィス）を高密度に配列することができるために、高解像力を得ることができると同時に、記録ヘッドとして全体的にはコンパクト化が計れ、且つ量産に向くこと、更には半導体分野において技術の進歩と

を流して通電されることによって、熱の電極の間の熱発生部118で熱エネルギーを発生する。熱作用面115は、発生した熱が液体に作用するところであり、熱発生部116と密接な関係がある。この熱作用面115での熱作用により液体中にバブルが発生し、その圧力エネルギーにより液体がオリフィス108から飛翔的飛出となって吐出され記録が実施される。

電圧供給体102のそれぞれを記録信号に従って駆動させて所定のオリフィス108から液体を吐出させるには、選択される選択電極112と共通電極114とを通じて信号電圧を供給することによって実施される。

以上説明した従前の液体噴射記録装置の構成に加え、本発明の液体噴射記録装置に於いては、それぞれの飛出路上に、オリフィス108とは別の第2の開口119が設けられる。

この第2の開口119は、前述したインク詰めの時に飛出路118の奥（前壁板103の近傍）に空気

が飛出ることによるオリフィスから飛出物の不安定化を防止するために設けられるもので、インク詰めの時に飛出路内に存在する空気はオリフィス108からだけでは抜けない部分を強く補助的な役割を要す。

第4図は第1～3図に示した液体噴射記録装置の飛出路部分の部分拡大図であり、オリフィス108と第2の開口119との間の飛出路は、オリフィスからの飛出物を効果的に行ない、かつ熱作用面115から液体に熱エネルギーが与えられた際に第2の開口から飛出物が生じないようにするために、この第4図に示されるように設けられるよう隔壁117の形状を定めるのがよい。

第2の開口119は、一般に飛出路の最も奥、すなわち前壁板103に近接して、1個以上設けられ、その径はオリフィス108より小さいものであることが好ましい。

第5a図及び第5b図は、本発明の液体噴射記録装置における隔壁117及び第2の開口119の設置様式の好適な変形例を示した模式図である。

7

以下、本発明を実施例に従ってより具体的に説明する。

実施例1

表面を酸化してSiO₂層を3μm厚に形成したSi基板をエッチングにより共通電極部分として100μm取り除いた。次に発熱抵抗層としてTa層を2000Å厚、電極としてAl層を1μm厚蒸着した後、フォトリソ工程により形状80μm×100μmの熱発生部（ヒーター）アレーを125μmピッチで形成した。また、Ta層の酸化防止及びインク液の浸透防止、液体が熱エネルギーを受けた際に発生されるバブルによる機械的衝撃用の膜として、SiO₂層0.5μm厚、SiC層1μm厚を順次スパッタリングにより積層して保護層を形成した。

次にこの基板の上に第1～4図で示されるような幅さが30μmの隔壁、前壁板、後壁板、二つの側壁板、オリフィス板及び供給管を設置し液体噴射記録装置を作製した。隔壁で仕切られる飛出路の幅は、広い部分で80μm、狭い部分で20μmであり、共通電極（ここでは隔壁で仕切られてい

8

る飛出路部分は含まない）と熱作用面間の距離は800μm、熱作用面と飛出路幅が20μmになる部分までの距離は50μm、飛出路幅が20μmの部分の長さは50μm、第2の開口が設けられる第4図右奥の部分は幅80μm、長さ100μmであった。オリフィス板は30μm厚のニクロム板からなり、エッチングにより40μm径のオリフィスがそれぞれの熱作用面の中央の真上から50μm共通電極側に位置し、20μm径の第2の開口がそれぞれの飛出路の奥から25μmのところへ位置するよう形成されている。

この液体噴射記録装置に対して8μsecの矩形電圧を与えて駆動させた。この場合の飛出物の最高周波数応答f_{max}は7kHzであり、各オリフィス間の飛出物のバラつきはなかった。また、吐出スピードも各オリフィスで12μl/secとほぼ均一であり、第2の開口からは、飛出物の吐出は全く生じなかった。

他方、第2の開口がなく、他は全く同様にして製作された液体噴射記録装置に対して同様な吐出試験を実施したところ、各オリフィス間で最高周

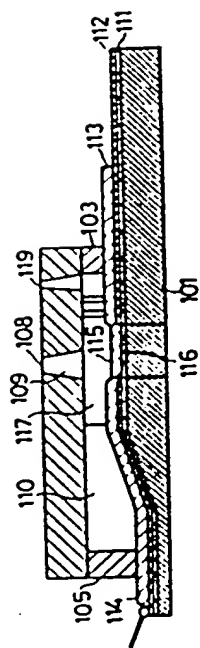


图 2

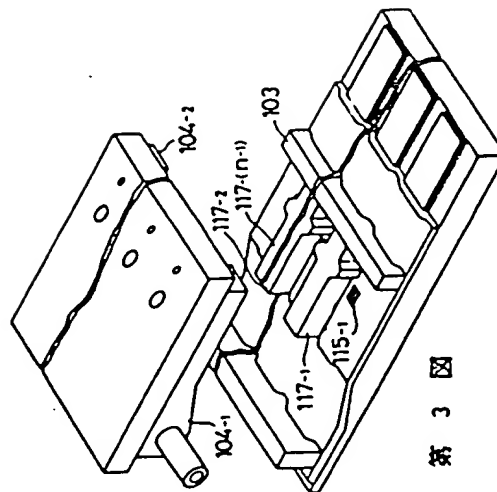


图 3

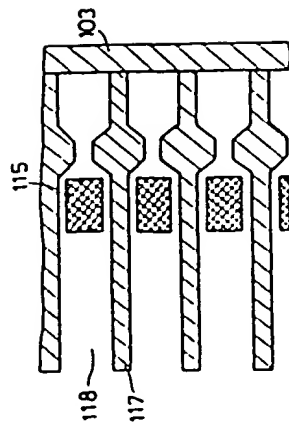


图 4